

Title (en)  
Contact disposition of a vacuum switch.

Title (de)  
Kontaktanordnung einer Vakuumschaltröhre.

Title (fr)  
Disposition de contact d'un interrupteur sous vide.

Publication  
**EP 0186030 A1 19860702 (DE)**

Application  
**EP 85115659 A 19851209**

Priority  
DE 3446170 A 19841218

Abstract (en)  
[origin: US4717797A] For generating an axial magnetic field, conductor loops are disposed behind the contact members in vacuum switching tubes. The terminals of these conductor loops are supported in axial direction by supporting parts having poor electrical conductivity. In order to reduce the mass of these conductor loops, it is provided that the supporting part be dimensioned such that it represents an electrical shunt to the adjoining conductor loop the electrical conductance of this shunt amounting to at least 1/4 of the electrical conductance of the conductor loop, the invention is suitable for axial field contacts comprising at least one conductor loop disposed behind the contact member.

Abstract (de)  
Zur Erzeugung eines axialen Magnetfeldes werden in Vakuumschaltröhren Leiterschleifen hinter den Kontaktstücken angeordnet. Die Anschlüsse dieser Leiterschleifen sind durch elektrisch schlechtleitende Stützteile (18) in axialer Richtung abgestützt. Zur Verringerung der Masse dieser Leiterschleifen wird vorgeschlagen, daß das Stützteil (18) so dimensioniert wird, daß es zur angrenzenden Leiterschleife (21, 22) einen elektrischen Nebenschluß darstellt, dessen elektrischer Leitwert zumindest ein Viertel des elektrischen Leitwertes der Leiterschleife (21, 22) beträgt. Die Erfindung eignet sich für Axialfeldkontakte mit zumindest einer hinter dem Kontaktstück angeordneten Leiterschleife.

IPC 1-7  
**H01H 33/66**

IPC 8 full level  
**H01H 33/66** (2006.01); **H01H 33/664** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**H01H 33/664** (2013.01 - EP US); **H01H 33/6642** (2013.01 - EP US); **H01H 33/6644** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)  
• [A] FR 2520927 A1 19830805 - ELEKTROTEKHNICHESKY INST [SU]  
• [A] GB 1345693 A 19740130 - HITACHI LTD  
• [A] DE 2546376 A1 19760624 - INST PRUEFFELD ELEKT  
• [A] US 4117288 A 19780926 - GORMAN JOSEPH G, et al

Cited by  
EP0763841A3; EP0709867A1; US5861597A; EP0794545A1; FR2745946A1; US5877466A

Designated contracting state (EPC)  
CH DE FR GB LI

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0186030 A1 19860702**; JP S61147417 A 19860705; US 4717797 A 19880105

DOCDB simple family (application)  
**EP 85115659 A 19851209**; JP 28015185 A 19851212; US 78857085 A 19851017